

# 一個學院最適應



■ 波長可変レーザー



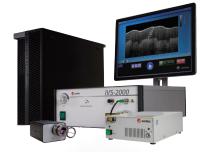
■ 光学特性検査システム



■ LCOS 型 空間光変調器



■ 偏波測定



■ 計測システム



■ 波長可変フィルタ



皆様のご研究にお役立ていただける 弊社製品のラインアップをウェブ サイトにも掲載しています。

製品情報の詳細は、 裏面をご覧ください。

# 研究・開発に最適な光応用製品



# ■ 波長可変レーザー

#### 最新ハイエンドモデル TSL-770



波長可変範囲 1480 to 1640 nm 最速 200 nm/s で全域モードホップフリー掃引可能 波長精度 0.5 pm、最大パワー + 13 dBm、 スペクトル線幅60kHz、周波数ゆらぎ 従来比1/10以下

#### 最新スタンダードモデル TSL-570



2021 年 4月リリースの最新鋭機 ご用途に合わせた波長帯や精度を選択可能 波長精度 3 pm ~、最大パワー + 13 dBm

# ハイパワーモデル TSL-570 Type H



最大パワー +20dBm 波長可変範囲 1260 to 1360 nm or 1500 to 1630 nm シリコンフォトニクスなどの評価用光源に最適

# 超広帯域のフルバンドモデル Full-band TSL



波長可変範囲 1260 to 1680 nm (O to U-band) 100 nm/s 波長掃引可能 オペレーションソフトウェア付属

# ステップ可変エコノミーモデル WSL-110



最大2台のレーザーを搭載可能(C or L-band) 任意波長に設定可能

#### 高速波長掃引型 VCSEL タイプ HSL-1



MEMS 技術とVCSEL 技術を融合 中心波長 1060 nm、掃引速度可変 10 to 400 kHz LiDAR などのセンシング用光源に最適

# 高速波長掃引型 MEMS タイプ HSL-10/20



SS - OCT 用スタンダード光源 中心波長 1060 nm or 1310 nm スキャンレンジ ≥ 105 nm

# ■ LCOS 型空間光変調器

# パイスピードモデル SLM-210



反射型 LCOS で光の位相を自由に変調 Full-HD 解像度、10-bit (1024 階調) 優れた位相安定度 ( $\sim 0.002\pi$  rad.)

# 紫外線耐性モデル SLM-250



液晶及び光学薄膜構造を耐紫外線に最適化 波長範囲 365 to 550 nm

# 高出力耐性モデル SLM-300



液晶及び放熱構造を耐高出力レーザーに最適化 対応波長 532 nm、800 nm、1064 nm

# ■ 光スイッチ

# 1xN、2xN メカニカルモデル OSX



低損出 <0.5 dB 高い再現性 ± 0.005 dB 最大 360 ch まで対応 8x8 などにもカスタマイズ可能 タッチパネル採用による優れた操作性

#### ■ 光アッテネータ

#### 標準モデル OVA



最大ダイナミックレンジ 100 dB アッテネーション精度 ± 0.1 dB 高い再現性 ± 0.01 dB Attn.後のパワーモニタ機能(オプション)

# ■ 光学特性検査システム

# スイープテストシステム

波長可変レーザー TSL シリーズ マルチポートパワーメータ MPM シリーズ 偏波コントローラ PCU-110 マルチブランチユニット MBU

IL / WDL / PDL の効率的な測定を実現 分岐ユニットにより更なる検査・評価の効率化が可能 オペレーションソフトウェア付属

# ■ 波長可変フィルタ

# フィルタ形状可変 Top flat タイプ OTF-980



透過波長と帯域幅を可変 非常に急峻なフィルタスロープ 1000 dB/nm エコノミーモデル(OTF-350 手動可変)も用意

# フィルタ形状 Gaussian タイプ OTF-930



豊富なフィルタ種類ラインアップ 低 PDL(< 0.1 dB) & 低 PMD(< 0.1 ps) エコノミーモデル (OTF-320 手動可変) も用意

# ■ 偏波測定

# 偏光消光比モニタ PEM-340



偏光消光比、偏光角度、光強度を同時測定 最大 50 dB までの消光比をリアルタイムに測定可能 広い光入力範囲 (- 40 to +20dBm / 1260 to 1630nm)

# 高消光比光源 PLS-100



0 から 180 度の間で偏光軸の角度を可変 45 dB(代表値)の高消光比 PMF デバイスの PER 測定に最適

# ■ 計測システム

# ラック・マウント型 PD アレイ MPA-100



高集積、コストパフォーマンスに優れた光パワー計測器 当社製光部品 (タップ PD or Pigtail PD) を最大 80 ch 搭載 多 ch 常時光パワーモニタや検査等に最適

# Swept Photonics Analyzer (OFDR) SPA-100 \* Preliminary



高分解能な光路長 & 損失分布解析システム シリコンフォトニクス (SiP)、フォトニック集積回路 (PIC) の ファイバ結合、デバイス内部の損失位置計測に最適 詳細はお問い合わせください

# 光学式断層測定 (OCT) IVS シリーズ



波長掃引型 OCT(Swept-Source OCT)システム 物の内部を非接触、非破壊、非侵襲で見ることが可能 最大 30 fps のリアルタイム・イメージング

#### 光学式三次元測定 OPS-1000



ダイナミックレンジ 70dB 超高感度 3D プロファイラー 高分解能 0.2 µm ~ 形状、材料、色、表面、外乱光の状態を問わず、 非接触・高速測定が可能

# ■ 光パワーメータ

# マルチ ch モデル OPM



InGaAs タイプ 830 to 1700 nm Si (シリコン) タイプ 400 to 1100 nm 交換式アダプタにより各種コネクタに対応 タッチパネル採用による優れた操作性 4ch ハーフラックタイプ有り

www.santec.com

